

低真空镀膜仪

仪器基本信息			
仪器中文名	低真空镀膜仪		
仪器英文名	Low vacuum coating machine		
仪器型号	Leica EM ACE 200		
生产厂家	德国 徕卡		
工作状态	正常		
			
		主要技术指标	
		真空度	$\leq 7 \times 10^{-3}$ mbar
		工作距离	30mm~100mm
		溅射电流	0-150mA 可调
样品仓	140mm（宽）×145mm（深）×150mm（高）		
主要配置与附件			
真空泵	adixen 2005SD, 双级旋片		
靶材	Pt, $\Phi 54$ mm, 99.99%, 21.5g/cm ³ , 厚 0.17mm		
功能用途及样品要求			
功能及特点	主要用于扫描电镜前处理；利用离子溅射镀金属膜来增加样品的导电性，以便减少电镜观察时产生的荷电，并增强二次电子或背散射电子信号，获得更好的信噪比。		
测品要求	干燥的薄膜、粉末、块体等。		
联系方式			
仪器安放地点	深圳西丽大学城北大园区 G 栋 208A		
仪器负责人	赵文光		
联系电话	13656778123		
Email	Zhaowg@pkusz.edu.cn		
仪器预约			
预约说明	接受校内 预约 ，校外预约请直接联系仪器负责人		
收费说明	见 收费标准		